

Christian LACROIX

christian.lacroix6@orange.fr

06 46 55 38 28

12 rue Bellevue

38120 SAINT EGREVE

MANAGEMENT DE PROJETS A FORTS ENJEUX TECHNOLOGIQUES

**EXPERTISE INDUSTRIELLE AU SERVICE DE L'INNOVATION DANS LES SECTEURS DE L'ENERGIE, DE
L'AUTOMOBILE, DE LA RECHERCHE ET DE LA MICRO-ELECTRONIQUE**

PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPETENCES

- ◇ Pilotage complet de projets à partir de cahiers des charges fonctionnels.
- ◇ Management transversal d'équipes pluridisciplinaires internes et externes
- ◇ Co fondateur d'une entreprise en technologies innovantes.
- ◇ Développement procédés et technologies vide et plasma.
- ◇ Co développement et partenariat

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2008 -> fin 2017 **SDMS LA CHAUDRONNERIE BLANCHE®** - 100 personnes, 13 M€ de CA ; Spécialiste du mécano-soudage et de la chaudronnerie des métaux nobles, SDMS conçoit et fabrique des objets uniques et innovants pour les grands acteurs de la Recherche, du Nucléaire, du Vide et de la Cryogénie.

CHEF DE PROJETS AU DEPARTEMENT DES GRANDS PROJETS

Management de projets à fortes exigences technologiques et documentaires.

Secteurs énergie / nucléaire

- Conception, réalisation et intégration sur site d'un ensemble de 5 autoclaves. CA de 3 M€ - Durée 2,5 ans (projet EM3, Atelier émission UF6 / AREVA-NC Pierrelatte).
- Fabrication d'un ensemble de boites à gants équipées pour le transfert motorisé de pastilles MOX et de traitement des gaz. CA de 4 M€ - Durée 3,5 ans (Projet combustible MOX USA).
- Conception, fabrication et qualification d'un ensemble d'outillages pour les sous-marins d'attaque Barracuda. CA de 2.5 M€ - Durée 3,5 ans (Projet BARRACUDA / AREVA-TA).

Secteurs Recherche / vide et Cryogénie

- Fabrication de cavités supraconductrices et cryostats pour les accélérateurs de particules CA de 2 M€ - Durée 2 ans (Projets Spiral2, IFMIF, ESS / CEA Saclay -IPN Orsay).
- Conception, fabrication et qualification de cryostats pour optiques IR embarquées. CA de 500 K€ - Durée 1,5 ans (Projet SIELETTERS / ONERA).
- Divers Fabrications: tubes d'inertie pour accélérateur du CERN, enceintes cryostats pour télescope (projet ALMA / ESO), enceinte de compression LASER optique (projet ELFIE/ école Polytechnique).

2002 -> 2008 **SOCIETE AVSIS 38601 FONTAINE** -SAS 15 personnes, filiale du groupe industriel Michel Baulé SA. Conception et réalisation d'équipements dans le domaine des technologies du vide du plasma et du soudage.

Co fondateur de la société en juillet 2002, par essaimage de 15 collaborateurs ingénieurs et techniciens (CA sur les 5 derniers exercices 25 M€, AVSIS primée leader croissance CCI Grenoble en 2005).

Chef de Projets et Responsable des études et du développement

Management de projets à forte technicité (CA de 200 à 3 M€). Etudes de faisabilité, avant-projet, expertise, analyse technico-économique.

Réalisations industrielles innovantes : machine de dépôt sous vide en continu et en batch, production d'équipement pour la gravure profonde du silicium, banc de contrôle d'étanchéité hélium, équipement de soudage haute énergie FE et laser.

Secteurs : industrie automobile, défense, médical, technologies des MEMS, recherche.

Missions particulières

- Développement de la notoriété de AVSIS (salon, membre de la SFV et du réseau plasma): en 5 ans, acteur national reconnu, AVSIS s'est constituée une clientèle de grands comptes et de starts up.

- Co conception et industrialisation de produit en partenariat avec des starts up du milieu scientifique et médical (diffractomètre RX / XENOCOS, appareil de désinfection par voie sèche d'instruments médicaux / GERMITEC).

1991 -> 2002 **SOCIETE SIGN (FILIALE COGEMA EX AREVA), 38 VEUREY VOROIZE**

Ensembleur / machine spéciale secteur nucléaire et industriel

1993 -2002 **Chef de Projets**

Management de projets industriels (CA 100 K€ à 2 M€), intégrant des spécificités process, Secteurs d'activités concernés : nucléaire, automobile, médical, aéronautique.

Technologies et procédés mis en œuvre : vide, thermique, plasma froid, dépôt sous vide, soudage.

Missions particulières

- En charge des actions de diversification sur les secteurs industriels autour des procédés sous vide: co-développement de procédé de dépôt pour le secteur automobile, mise en place d'un partenariat pour l'industrialisation et l'intégration d'équipement de gravure plasma pour les micro- technologies.

- Responsable technique sur grand projet SILVA « Enrichissement laser / module usine » (budget 12 M€, 24 mois)

1991- 1993 **Responsable activité équipement dépôt sous vide**

Management équipe intégrée de 5 techniciens : bureau d'étude, montage, essais.

Conception et réalisation de machine de dépôt sous vide.

Brevet international pour concept innovant équipement process continu.

1984 -> 1991 **ALCATEL CIT DIVISION VIDE ET MECANIQUE 74 ANNECY**

Equipementier pour l'industrie de la microélectronique / technologie du vide

1987 - 1991 **Ingénieur produit gravure**

Responsable technique de la ligne de produit machine de gravure ionique réactive.

Pilote des actions d'industrialisation et d'amélioration des équipements.

Missions particulières

- Responsable de mission pour le démarrage de lignes de production (6 à 20 machines) sur plusieurs sites en Russie (de 1986 à 1990)

1984 - 1987 **Ingénieur process gravure / Responsable du laboratoire d'application gravure**

Management d'une équipe de 6 techniciens,

Développement des procédés de gravure plasma et technologies réacteur en collaboration avec des laboratoires Français (CEA LETI) et Japonais (Canon),

Démonstration des procédés avant-vente des équipements

FORMATION

- ◇ Contingent scientifique au Laboratoire de Physique des Matériaux (Clermont –Ferrand)
- ◇ Diplôme d'Ingénieur Génie Physique – ex CUST (Clermont –Ferrand), sorti en 1983
- ◇ DUT Mesures Physiques Grenoble
- ◇ Anglais professionnel

CENTRE D'INTERETS

- ◇ Pratique régulière du VTT, de la randonnée à ski et pédestre.